

7.- III Incontro: Trattamento Chimico. Processo di Etching per monitoraggio del Radon.

Primary author: Dr CARTURAN, Sara Maria (UniPd -INFN)

Presenters: BERMUDEZ, Judilka Ivanna (Istituto Nazionale di Fisica Nucleare); Dr CARTURAN, Sara Maria (UniPd -INFN)